【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成17年12月22日(2005.12.22)

【公表番号】特表2004-535580(P2004-535580A)
【公表日】平成16年11月25日(2004.11.25)
【年通号数】公開・登録公報2004-046
【出願番号】特願2003-514204(P2003-514204)
【国際特許分類第７版】
　ＧＯ１Ｂ　21/00
　ＧＯ１Ｂ　11/00
【ＦＩ】
　ＧＯ１Ｂ　21/00　　Ｅ
　ＧＯ１Ｂ　11/00　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成17年2月10日(2005.2.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面（３６，３８，５８，６０）上に支持され、該表面に対して相対的に移動可能な形状探触要素（３０，４４）ならびに表面特性の直接的測定のための光電子式距離センサ（３２，４８）を備えた座標測定装置を使用して、加工品（３４）の表面特性を測定する方法において、該光電子式距離センサ（３２，４８）は、選択に応じて該加工品（３４）の表面特性を直接測定し、もしくは該距離センサで形状探触要素（３０，４４，４６）の位置、又はこれに割当てられた標識の位置が該加工品の表面特性を決定するために測定されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　形状探触要素（３０，４４，５６）として触針を使用することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　形状探触要素（３０）として光触覚式ファイバ形プローブを使用することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ビデオオートフォーカス法、レーザオートフォーカス法又はフーコーのナイフエッジテスト方式で作動する距離センサ（３２，４８）を使用することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　距離センサ（３２，４８）と画像処理センサを組み合わせることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　形状探触要素（３０，４４，５６）がインタフェースにより距離センサ（３２，４８）の光路に配置され又はこの光路から除去されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　インタフェースとして、座標測定装置にある探触系ために利用されるインタフェースを使用することを特徴とする請求項１に記載の方法。

【請求項８】
座標測定装置の座標軸（Ｘ、Ｙ、Ｚ）に沿って移動可能な形状探触要素（３０、４４）ならびに光電子式距離センサ（３２、４８）を具備する、加工品（３４）の表面特性の測定のための座標測定装置（１０）において、光電式距離センサが選択に応じて該加工品の表面（３６、３８、５８、６０）を直接測定するか又は形状探触要素（３０，４４）の位置、又はそれに固定して割り当てられた標識の位置を測定するように、該形状探触要素（３０、４４）が光電子式距離センサ（３２，４８）に対して調整可能に配置されていることを特徴とする座標測定装置。
【請求項９】
形状探触要素（３０、４４、５６）が触針であることを特徴とする請求項８に記載の座標測定装置。
【請求項１０】
形状探触要素（３０、４４）が光触覚式ファイバ形プローブであることを特徴とする請求項８に記載の座標測定装置。
【請求項１１】
光電式距離センサ（３２、４８）がレーザオートフォーカス法、ビデオオートフォーカス法又はフーコーのナイフエッジテスト方式により作動するセンサであることを特徴とする請求項９に記載の座標測定装置。
【請求項１２】
座標測定装置（１０）が画像処理センサ（４６）を有し、場合によっては画像処理センサ（４６）が距離センサ（３２、４８）と組み合わされていることを特徴とする請求項８に記載の座標測定装置。
【請求項１３】
形状探触要素（３０、４４）がインタフェースにより調整可能であることを特徴とする請求項８に記載の座標測定装置。
【請求項１４】
インタフェースが座標測定装置（１０）にある探触系のために利用されるインタフェースであることを特徴とする請求項１３に記載の座標測定装置。